(19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-61489

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和61年(1986)3月29日

H 05 K 3/18 C 23 C 18/16 7216-5F 7011-4K

未請求 発明の数 1 (全4頁) 審杳諳求

の発明の名称

プリント配線板の製造方法

2)特 昭59-182729 願

22出 願 昭59(1984)9月3日

⑫発 明 者 久 ②発 明 者 吉

保 文 英 Ш 博

秩父市大字下影森1248番地 キャノン電子株式会社内 秩父市大字下影森1248番地

キャノン電子株式会社内

⑫発 明 者 仲

之 垒 Ш

婧

キャノン電子株式会社内 秩父市大字下影森1248番地

者 中尾 79発 明

宏 秩父市大字下影森1248番地 キャノン電子株式会社内

キャノン電子株式会社 仍出 顖 79代 理 弁理士 若 林

秩父市大字下影森1248番地

明 細.

1. 発明の名称

プリント配線板の製造方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 絶縁基板に無電解メツキを施すことにより導 体回路を形成し、プリント配線板を製造する方 法に於て、前記絶縁基板(以下基板と云う)の 表面にメッキ触媒層を形成処理する第1工程、 前記第1工程で処理された前記基板の表面上の 非導体回路部分の触媒層を熱により非触媒化処 理する第2工程、前記第2工程で処理された前 記基板の触媒層を活性化処理する第3工程、前 記第3工程で処理された前記基板の表面に無電 解メッキを施し所望の導体回路を形成する第4 工程とから成ることを特徴とするプリント配線 板の製造方法。
- 2. 該第2工程における非触媒化処理を加熱接触 体と非導体回路部分の触媒層との接触によつて 行うことを特徴とする特許請求の範囲第1項記 載のプリント配線板の製造方法。

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、化学メッキ法を用いて、片面プリン ト配線板、両面プリント配線板、多層プリント配 線板、フレキシブル配線板等を製造するプリント 配線板の製造方法に関するものであり、さらに具 体的に云えば、導体回路を無電解メッキを施すこ とにより形成させるアディティブ方式によるプリ ント配線板の製造方法に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、プリント基板の導体回路の形成はエッチ ングによる方法、あるいは電解メッキによる方法 等により行なわれている。このエッチング方法に よる導体回路の形成は、具体的にはプリント基板 上に成層した金属導体の非エッチング部分にスク リーンやオフセット等の印刷によりインキレジス トを設けるか、又は感光性樹脂の硬化膜層を設け たのち、不必要な部分をエッチングし、非エッチ ング部分のレジスト等を除去することにより導体 回路を形成する方法である。これによれば金属の

導体をエッチングによって除去する為、省資源的ではなく、さらにレジスト等の形成、除去を必要とする為に工程数が多いという欠点があった。又電解メッキによる方法は導体基板上の非メッキを施して導体回路を形成し、この方法では非常に複雑な工程となる。

一方、上記二法の欠点を解決する為に無電解メッキによって導体回路を形成するアディティーとがある。これにはCC-4法、PSMD法が一般的で、CC-4法では絶縁基板上にメッキ触媒性の付与された接着剤層を形成し、その非メッキにの分にレジスト等の硬化層を設け無電解メッキにより導体回路を形成するものであるには、ツキ触媒層を形成し、その非メッキを施と導体回路を形成するものである。

された前記基板の表面に無電解メッキを施し所望 の導体回路を形成する第4工程とから成ることを 特徴とするものである。

メッキ触媒層は一般的に使用されている塩化パラシウムー塩化第1スズの混合錯溶液(例えば、HS101B,日立化成工業株式会社製品)を使用し、上記溶液への基板の浸渍あるいは溶液の塗布、吹付等によつて形成する。上記工程に先立つて基板表面を適当な方法で凹凸にする事により、触媒層の形成効果はより向上する。この方法には、本ーニング処理等の物理的粗面化方法や、酸化性溶液による化学的粗面化方法が上げられる。

触媒層の非触媒化処理の方法は非導体回路部分に相当する触媒層を熱によつて不活性化するものである。例えば加熱接触体の該部への接触によって行うことができる。加熱接触体としては、金属板、セラミック板等が上げられる。金属板等の加熱方法には金属板等の内部にヒーターを内蔵させるか、金属板自体を二クロム等の発熱抵抗金属で製造するか、あるいは赤外線等で間接的に加熱す

[発明が解決しようとする問題点]

本発明は無電解メッキ法によつて導体回路を形成するアディティブ法の改良である。

CC-4法においては基板に接着剤層を形成し、 その上にレシスト等の形成を必要とするという不 便があり、又PSMD法ではレンスト等の形成を 省略できるが、紫外線処理した後、導体回路を形 成するという製造上むずかしい方法である。

本発明はこれらの欠点を除去すると同時にまつ たく新しいアデイテイプ法によるプリント配線板 の製造方法を提供するものである。

[問題点を解決するための手段]

本発明の製造方法は、絶縁基板に無電解メッキを施すことにより導体回路を形成し、ブリント配線板を製造するもので、前記基板の表面にメッキ触媒層を形成処理する第1工程と前記第1工程で処理された前記基板の表面の触媒層を活性化処理する第3工程と前記第3工程で処理された前記基板の表面の触媒層を活性化処理する第3工程と前記第3工程で処理

る方法がある。

触媒層の活性化方法としては一般的に使用されているメッキ触媒活性化液(例えば、フッ化水素酸-塩酸系水溶液、商品ではOPC-555アクセレータ、奥野製薬工業㈱製品)を使用し、上記溶液への基板の浸漬、あるいは溶液の塗布、吹付等によつて行なう。

無電解メッキ液としては無電解ニッケルメッキ液、無電解銅メッキ液等が上げられる。

特開昭 61-61489(3)

層 2 をメッキ触媒活性化液へ基板を浸漬等することにより活性化層 5 を形成させる(第 3 工程)。次にこれを通常の方法によつて無電解メッキを施すと、第 4 図に示す様に活性化層 5 の上に還元メッキ金属 6 が析出され(第 4 工程)、所望のプリント配線板が製造される。

第1工程に於る赤外線電球、又は熱風等による 乾燥温度は高すぎるとメッキ触媒層が非触媒化す るので、 60 ℃以下の温度で乾燥するのが望ましい。 さらに第2工程に於る金属板等の温度は、低性化 で非触媒化が進行しなく、第3工程での活性化 で非触媒化層が活性化層に反応する危険性がある。 又高すぎると基板の軟化、溶解等の危険性がいる。 入窓着する時間は、金属板等の温度及び基板 等により適宜決定されるが、1分~10分が望ましい。

以下実施例により本発明を具体的に説明する。 実施例

厚さ 200 μm のポリエステルフイルムをホーニン

らず他の基板、例えばポリカーポネート基板、ガ ラスエポキシ基板等にも適用出来ることは云うま でもない。

〔発明の効果〕

以上の様に本発明によれば、熱によつてメッキと 触媒層を非触媒化し無電解メッキによつてプリン を記線板を製造するという比較的形成、な工程の がもエッチング、レ等の形成、板をを引 がもエッチ、安価で大量のプリント配線板 で大量のプリントの表を発現 する方法によって、カファンカステンの を登りたまった。 をできる。 ををした。 ををした。

4. 図面の簡単な説明

第1~4図は本発明の製造方法の工程を示す逐次段階の部分拡大図である。

1 … 基板、 2 … メッキ触媒層、 3 … 加熱された金属板、 4 … 非触媒化層、 5 … 活性化層、 6 … 無電解メッキ金属。

グ処理し、2 mmの表面粗さの基板を得た。この基 板を、 HS101B(日立化成工業株式会社製品), 濃塩酸,水を1:5:10の割合で混合して得られ たメッキ触媒液に室温で 10 分間浸漬し、その後 1~2分水洗し、50℃の熱風で完全に乾燥させメ ツキ触媒層を得た。この表面上に、非導体回路部 分が導体回路部分に対し5%突き出た形状の厚さ 10 % 程度の鉄板にクロムメッキを 10 μm 施した 温度 200 ℃の非触媒化用の金属板を1分間密着さ せる。次に上記基板をOPC - 555アクセレータ (奥野製薬工業㈱製品)の20容量%の水溶液に室 温で3分間浸漬し、水洗1~2分の後、無電解ニ ツケルメツキ液としてシューマS680(硫酸ニツ ケルー次亜リン酸ソーダ系、日本カニゼン(精製品) の 20 容量%の 70 ℃水溶液に 10 分間浸漬し無電 解ニツケルメツキを施したところ、ニツケルの金 属によるフレキシブルプリント配線板が得られた。

前記実施例ではフレキシブルプリント配線板について例を上げたが、他の全てのプリント配線板にも適用出来る、又ポリエステルフイルムにかぎ

但し、各層厚は説明の為、適当に拡大されている。

特 許 出 願 人 キャノン株式会社 代 理 人 若 林





